

氦离子切割抛光制样，CP截面抛光技术

产品名称	氦离子切割抛光制样，CP截面抛光技术
公司名称	安徽方检检测技术有限公司
价格	100.00/件
规格参数	资质:cma/cnas 服务范围:全国 报告:资质报告，可加急
公司地址	新站区淝水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测中心
联系电话	13635694394 15856391810

产品详情

氦离子抛光技术又称CP截面抛光技术，是对样品表面进行抛光，去除损伤层，从而得到高质量样品，用于在SEM、光镜或者扫描探针显微镜上进行成像、EDS、EBSD、CL、EBIC 或其它分析

2台氦离子切割抛光设备，都配备温控液氮冷却台氦离子切割制样是利用氦离子束(—1mm) 来切割样品，以获得相比FIB制样(通常十几微米) 面积更大的电子显微分析区域。其制样原理是用一个坚固的挡板遮挡住样品的非目标区域，有效的遮蔽了下半部分的离子束，创造出一个侧切割平面，去除样品表面的一层薄膜。